

### WCS-300M : 全自動 / 一体型 VPD-ICP-MS システム

- WCS-300M : 全自動 / 一体型 VPD-ICP-MS システム
  - Sampling/VPD/ICP-MS を省スペースの筐体に収めた一体型システム。
  - ICP-MS システム校正、サンプルチューブの自動洗浄、清浄度の自己診断、スキャン溶液、クリーニング溶液の自動調製により前処理、後処理まで自動化。
  - 親水面、疎水面のどちらでも測定可能。
  - Full, Radial, Point, Edge, Bevel など、測定箇所をカスタマイズできます。
  - インターロックシステムと連動したリークセンサーとガス検知器を装備。
  - 駆動部、試薬吐出部を筐体に収め、作業者への衝突、被液を防止。

### 製品イメージ



- WCS-300M : ウェハ上の金属汚染を sub-ppt レベルで高感度分析が可能。高い安全性を持ち、前処理から後洗浄まで自動化した全自動 VPD-ICP-MS システム。